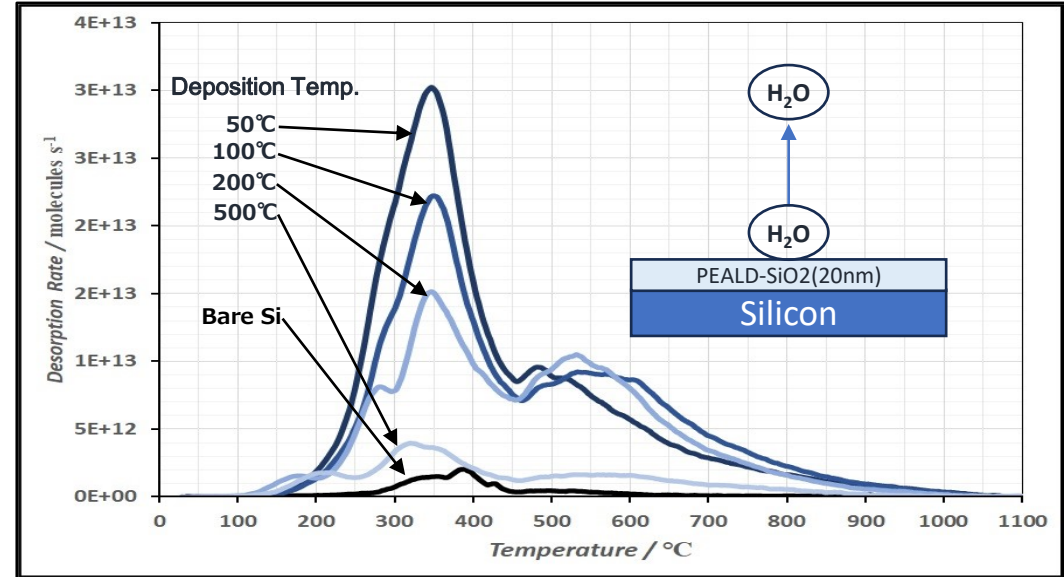


表面観察装置では検出が難しい絶縁膜（CVD膜・ALD膜等）に含まれる微量不純物を高感度に検出します。

Thermal Desorption Spectrometer 昇温脱離分析装置 TDS1200 II



Thermal Desorption profiles of H₂O in SiO₂ films deposited by PEALD



Thermal Desorption profiles of H₂O & NH₃ in SiN films deposited by PECVD

